

8	XXXXXXXXXXXXIS-MS	00 00	24557	akobayashi
9	XXXXXXXXXXXX-(LA-ICPMS)	00 00	24557	akobayashi

*: XXXXXXXXX@eps.s.u-tokyo.ac.jpXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX (XRD)

XXXXXXXXXX1

XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX PANalytical X'Pert Pro MPD

XXXXXX XXX1XXXXXX XXX1 B141 XXXXXXX

XXXXXXX XX
 XXX
 XXXXXXX 45XXXXXXXXXX
 XXXXX

XXXXXXXX Tel: 24557 XXXakobayashi[@]eps.s.u-tokyo.ac.jp



粉末X線回折 (XRD)

測定条件

測定装置 Rigaku RINT-2100

試料 100℃ 10 B141 X線

測定条件

(1) 測定条件

(2) 測定条件

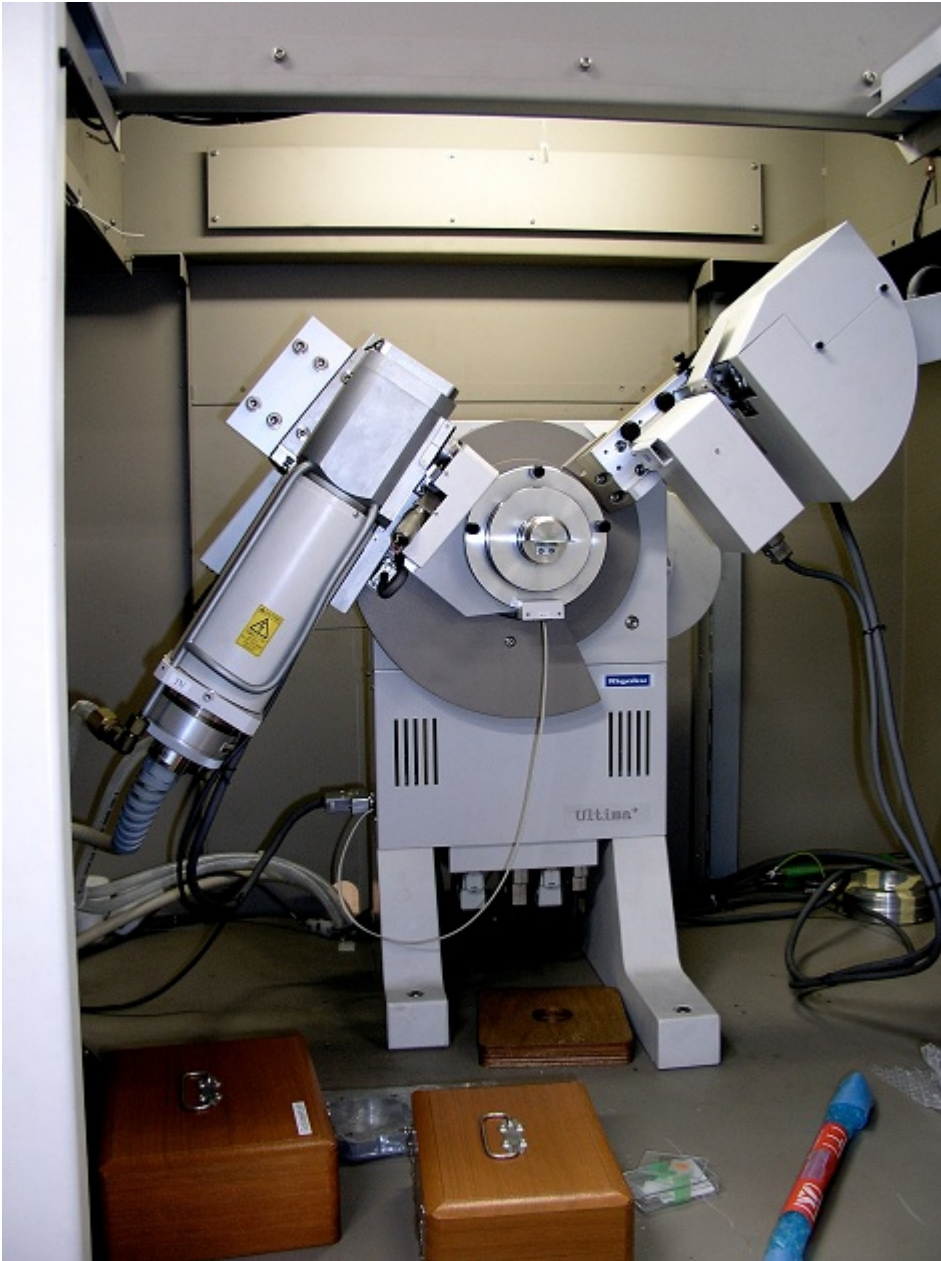
(3) 測定条件

(4) 測定条件

測定条件

測定条件

測定条件 Tel: 24557 ichimura[[@](mailto:ichimura@eps.s.u-tokyo.ac.jp)]eps.s.u-tokyo.ac.jp



日立製FE-SEM (FE-SEM)

3

Hitachi S-4500

1 2 B238

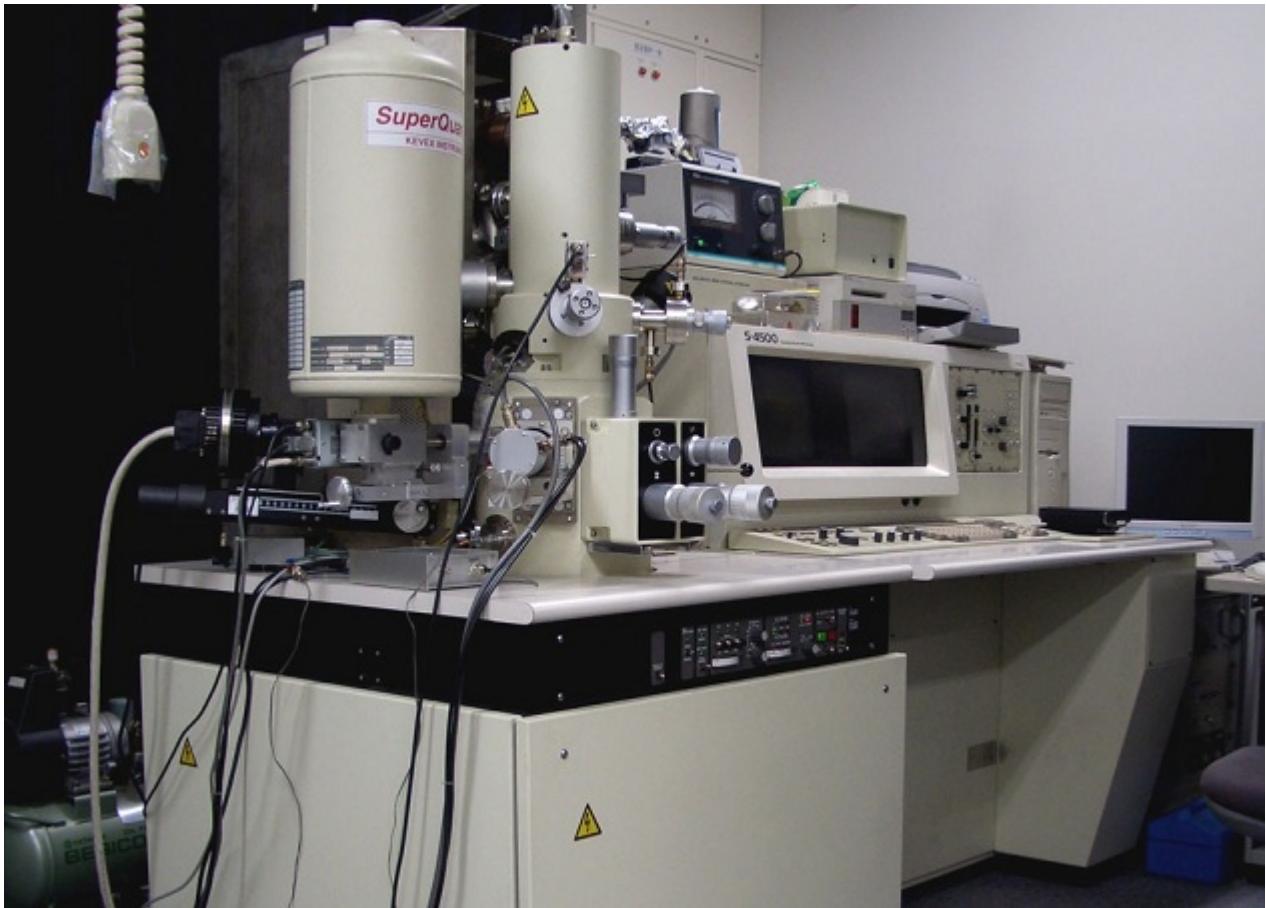
SEM 10

6

(1) (2) (3) BSE (4)

X EDS (5) EBSD (6) FSE

Tel: 24557 ichimura[[@](mailto:ichimura@eps.s.u-tokyo.ac.jp)]eps.s.u-tokyo.ac.jp



原子顕微鏡 (FE-SEM)

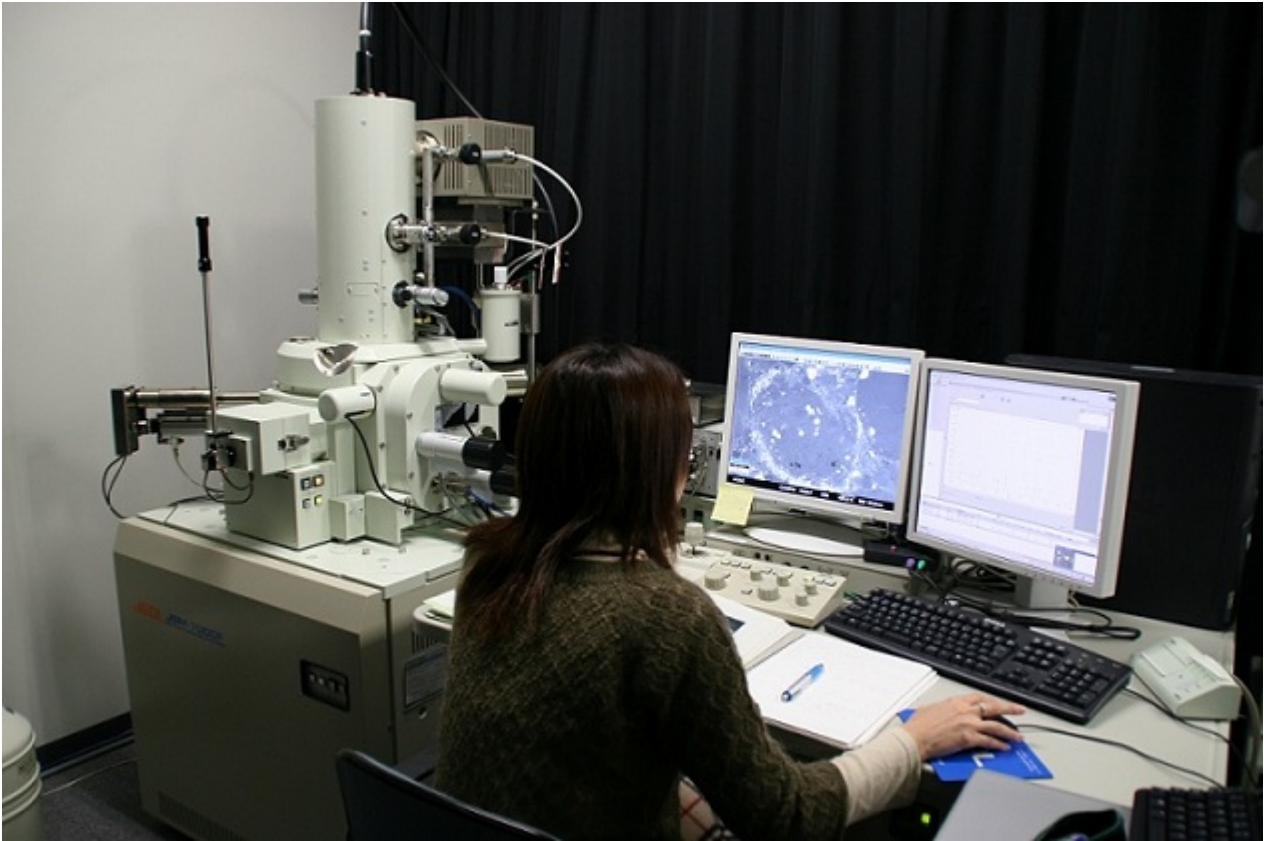
4

JEOL JSM-7000F

1 2 B238

2
10
2
2005 4
2005 4

Tel: 24528 yoshida[at]eps.s.u-tokyo.ac.jp



EPMA (EPMA)

5

EPMA (Electron Probe Micro Analyzer) JEOL JXA-8900L

1 B136 EPMA

1 X

(WDS)

5 1 X (EDS)

Tel: 24528 yoshida[@]eps.s.u-tokyo.ac.jp



分析装置紹介 (FE-EPMA)

装置番号 6

装置名 FE-EPMA JEOL JXA-8530F

装置位置 1階 第1号 B136号 EPMA室

本装置は「Electron Probe Microanalyzer; EPMA」と呼ばれるX線マイクロアナライザの一種です。Field Emission; FEと呼ばれる電子銃を用いて、試料表面からX線を発生させ、そのスペクトルを測定し、試料の元素組成を分析します。測定精度は約10ppm、検出限界は約5ppmと高く、X線分光分析装置 (EDS) と比較して約3倍の精度で元素分析が可能です。

お問い合わせ先 Tel: 24557 ichimura[at]eps.s.u-tokyo.ac.jp

